

Plasma Conference 2011 (PLASMA 2011)

参加人数(予定) : 1,000名(プラズマ・核融合学会、応用物理学会、日本物理学会の会員が中心)

国外100名、国内900名

2011年に誕生した新しい「国際会議」です。参加者、展示出展者との交流など、今までになかった学会講演会です。

※3学会(プラズマ・核融合学会、応用物理学会、日本物理学会)の合同開催となります！

出展対象

- 下記の製品・装置が研究に必要です！ -

プラズマ研究において、一般的に利用されている装置は下記が該当いたします。初めて開催される国際会議である「Plasma Conference 2011」は、関連する技術者・研究者が非常に注目しております。意外な分野の先生方から引き合いなどが予想され、業界の活性化、技術の躍進にご協力いただければ幸いです。

真空チャンバー (真空フランジ, ゲートバルブ, バタフライバルブなど)

真空配管

真空排気装置 (各種真空ポンプ)

真空計

各種電源 (直流, 交流, パルス, 高周波, マイクロ波)

電流導入端子

ガス

ガス導入用マスフローコントローラ

各種レーザー

光学部品 (各種レンズ, XYステージなど)

質量分析装置

発光分光分析装置

薄膜分析装置 (膜厚計, 各種表面分析装置)

薄膜形成装置 (スパッタリング装置, プラズマCVD装置, MBE装置など)

プラズマエッチング装置

イオンビーム, 電子ビーム, 中性粒子ビームなど

オシロスコープ

スペクトルアナライザ

赤外線加熱装置

など・・・

